



## 豊橋技術科学大学 開学30周年記念事業

## 社会人向け「第3回集積化RF MEMS技術講習会」のご案内

対象：高周波（マイクロ波） and/or MEMS が専門でない技術者

RF MEMS は、「高周波（マイクロ波）技術」分野に「MEMS 技術」を応用したもので、従来の高周波デバイスを上回る性能や新規なシステムを実現できる可能性を有する魅力的なデバイスとして注目されています。

RF MEMS の開発には、両輪となる「高周波技術」と「MEMS プロセス技術（CMOS 集積回路プロセスに MEMS 特有のプロセス技術を付加）」の習得が必要になります。

本講習会は、「高周波技術」と立体構造などの製作が必要な「MEMS プロセス技術」の全体像と要素技術の基本的な考え方や知識・技術を分かりやすく習得できるカリキュラム構成（講義と実習）になっております。

## 【 記 】

1. 日 時：平成20年11月14日（金）～15日（土）の2日間
2. 場 所：国立大学法人 豊橋技術科学大学 ベンチャービジネスラボラトリー  
〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1 (<http://www.vbl.tut.ac.jp/>)
3. 内 容：テーマ「集積化RF MEMS技術」－講義と実習－

日程	カリキュラム	
11 月 14 日 (金)	I 高周波回路の 基本的な考え方	(1) 高周波回路の特徴
		(2) 伝送線路の電波伝搬特性と特徴
		(3) スミス図表とその使い方 (+演習)
11 月 15 日 (土)	II 高周波回路設計の 基礎	(4) Sパラメータ (+演習)
		(5) 増幅回路設計の基礎 (+演習)
11 月 15 日 (土)	III 高周波スイッチ IC 設 計の基礎	(6) アンテナスイッチ IC 設計技術
		(7) RF MEMS スイッチ設計技術
11 月 15 日 (土)	IV 集積化RF MEMS スイッ チ；プロセスと実習	(8) 集積化RF MEMS 製造プロセス：講義
		(9) MEMS スイッチ製作実習
		(10) プロセス工程ツアーとQ&A
11 月 15 日 (土)	V 大学の研究紹介：MEMS 主要プロセス	(11) 血液検査用マイクロチップにみるシリコン MEMS プロセスの実施例

\*註11月14日10:00～17:30, 11月15日9:00～16:40

4. 参加費：7万円（消費税込み，テキスト・昼食代・懇親会費含む）／名
5. 定 員：15名（定員になり次第締め切らせていただきます）
6. 申込み：10月31日まで。次頁の「参加申込書」に内容を明記の上，E-mail（原田：[harada@eee.tut.ac.jp](mailto:harada@eee.tut.ac.jp)）またはFAX（0532-44-6979：中澤）でお申込み下さい。

【注1】申込者には参加費の事前納入の方法と詳細日程を別途郵送でお知らせします。

【注2】問合せ：豊橋技術科学大学・原田 ([harada@eee.tut.ac.jp](mailto:harada@eee.tut.ac.jp), TEL: 0532-44-1244)

7. 講 師：豊橋技術科学大学 教職員 他
8. 主 催：(株)豊橋キャンパスイノベーション (とよはしTLO)
- 共 催：豊橋技術科学大学 ベンチャービジネスラボラトリー (VBL)

以 上